

設備No	装置名	機種	設置場所	利用料/H	技術代行料	
1	1-1	X線光電子分光分析装置	アルバック・ファイ社製 ESCA 5800	W3-112	2200	24000/件
2	2-1	電子状態測定システム	島津製作所社製 AXIS-ULTRA	W3-116	2700	5800/1H
3	3-1	動的二次イオン質量分析測定装置	Analysetechnik GmbH社製ATOMIKA SIMS 4000	W3-212	1500	3900/1H
4	4-1	表面・界面分子振動解析装置	東京インストルメンツ社製Spectra-Physics	W3-310	1400	4500/1H
5	5-1	高速レーザーラマン顕微鏡	ナノフoton Raman-touc	W3-607	2000	4900/1H
5	5-2	レーザーラマン分光光度計 NRS-2000	日本分光社製NRS-2000	W3-115	3300	
5	5-3	プローブ型顕微ラマン分光測定装置	カイザーオプティカルシステムズ製RAMAN RXN Systems	W3-607	1600	4600/1H
6	6-1	レーザーラマン分光光度計 NRS-3100	日本分光社製 NRS-3100KK	W3-114	2300	4900/1H
7	7-1	UV-Vis-NIR分光光度計	島津製作所社製SolidSpec-3700DUV	W3-607	600	3600/1H
7	7-2	中赤外・遠赤外吸収測定装置	パーキンエルマー・ジャパン製 Spectrum400 FT-IR/FIR SpotLight400 IR イメージング	W3-115	670	3800/1H
8	8-1	紫外可視近赤外分光測定装置	日本分光社製V-670	W3-607	1500	4400/1H
9	9-1	超高速HPLC分離・分子構造分析システム	島津製作所nexeraX2(114)、Bruker micrOTOF-QIII(114)、日本分光J-1500(113)、大塚電子 DLS-8000DL(113)	W3-113 W3-114	1900	4800/1H
10	10-1	近赤外蛍光分光装置 Fluorolog-NIR	堀場製作所社製 Fluorolog-NIR	W3-708	1500	4100/1H
11	11-1	近赤外蛍光分光装置 NanoLOG-EXT	堀場JOBIN YVON社製NanoLOG-EXT	W3-612	1000	4000/1H
12	12-1	シングルフォトンカウンティング蛍光寿命計測定装置	浜松ホトニクス社製	W3-615	1200	4100/1H
13	13-1	核磁気共鳴測定装置	Bruker社製 Avance 500MHz	W3-109	940	1500/件
14	14-1	質量分析装置	JEOL社製 JMS-T100CS	W3-210	680	2700/1H
15	15-1	MALDI-TOF質量分析装置	BRUKER社製 Autoflex III	W3-114	1700	4500/1H
15	15-2	分離用小型超遠心機	日立工機社製CS100GXL	W3-612	330	3300/1H
15	15-3	分取HPLCシステム	日本分析工業社製LC-908-C60	W3-213	4200	7200/1H
16	16-1	走査型プローブ顕微鏡 PicoPlus 5500	アジレントテクノロジー社製 PicoPlus 5500	W3-113	570	3200/1H
16	16-2	表面抵抗率計	三菱化学社製 Loresta-GP	W3-612	830	3800/1H
16	16-3	表面形状測定装置	Veeco社製Dektak 6M		750	3200/1H
17	17-1	走査型プローブ顕微鏡 SPM9600	島津製作所社製SPM9600	W3-113	1200	4100/1H
17	17-2	走査型プローブ顕微鏡測定システム	Veeco社製nanoscopeIIIa	W3-113	2500	5400/1H
18	18-1	環境制御型ユニット付き多機能走査型プローブ顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー社製 SPA300HV	106	820	3300/1H
19	19-1	環境制御型多機能走査型プローブ顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー社製 SPI3800N	W3-111	380	3500/1H
20	20-1	超高分解能走査電子顕微鏡	日立ハイテクノロジー SU9000	W3-114	1500	4500/1H
20	20-2	3次元SEM画像測定解析システム	KEYENCE VE-9800	W3-114	1100	4000/1H
21	21-1	走査型電子顕微鏡 S-5000	日立社製 S-5000	W3-114	1900	4500/1H
22	22-1	透過型電子顕微鏡システム	日本電子社製 JEM-2010	W3-112	880	3800/1H
22	22-2	マイクロ構造観察顕微鏡システム	日本電子社製 大気圧走査電子顕微鏡 JASM-6200	W3-114	2900	6000/1H
23	23-1	ゼータ電位/粒径測定システム	大塚電子ELS-Z	W3-607	1100	4100/1H
24	24-1	ゼータサイザーゼータ電位・粒子径・分子重量測定装置	マルバーン社製Nano ZS	W3-514	2200	6200/1H
25	25-1	動的光散乱測定装置	Malvern社製 Zetasizer Nano ZS	W3-501	960	4000/1H
26	26-1	全自動水平型多目的X線回折装置	リガク社製SmartLab	W3-115	2300	5200/1H
27	27-1	単結晶X線構造解析装置	Bruker社製 SMART APEX	W3-204	3200	36000/件
28	28-1	マイクロカロリメトリー	MicroCal社 VP-ITC	W3-213	2500	5400
28	28-2	蒸気圧式絶対分子量測定装置	Gonotec社製 OSMOMAT 070	W3-113	260	2900/1H
28	28-3	蒸気圧式分子量測定装置	KNAUER社製Vapor Pressure Osmometer K-7000	W3-904	260	3400/1H
29	29-1	分子構造解析システム		W3-115	320	3300/1H
30	30-1	ナノ炭素燃料電池評価システム	東陽テクニカ社製(自動CV型燃料電池評価システム AutoPEM-ER02型、燃料電池評価システム AutoPEM-ER01型 テスター産業 高精度ホットプレス SA-501)	W4-112	340	3400/1H
30	30-2	触媒活性表面測定システム	日本ベル社製 自動批表面積/細孔分布測定装置 BELSORP-mini II 触媒分析装置 BELCAT-B		390	3500/1H
31	31-1	太陽電池特性評価システム	分光計器社製 SRO-25GD		4300	8200/1H